

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-202299

(43)Date of publication of application: 25.07.2000

(51)Int.Cl.

B01J 31/22 CO7C 2/32 CO7C 11/107 CO8F 4/60 C08F110/02 // C07B 61/00

(21)Application number: 11-011493

(71)Applicant: TOSOH CORP

(22)Date of filing:

20.01.1999

(72)Inventor: OGURI MOTOHIRO

MIMURA HIDEYUKI

OKADA HISANORI

(54) ETHYLENE TRIMERIZATION CATALYST AND METHOD FOR TRIMERIZING ETHYLENE **USING SAME**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently produce 1-hexene from ethylene with high selectivity by preparing an ethylene trimerization catalyst from a chromium complex with a coordinated neutral multidentate ligand, a metal alkyl compound and a topotactic reduction product accompanied with electron transfer.

SOLUTION: The ethylene trimerization catalyst for the production of 1- hexene useful as a comonomer of linear low density polyethylene from ethylene is prepared using at least a chromium complex with a coordinated neutral multidentate ligand, a metal alkyl compound and a topotactic reduction product accompanied with electron transfer. The topotactic reduction product has been subjected to salt treatment, acid treatment or other treatments). The chromium complex is represented by the formula ACrBn A is a neutral multidentate ligand, (n) is an integer of 1-3 and B is H, halogen, amido, alkoxide or the like].

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-202299 (P2000-202299A)

(43)公開日 平成12年7月25日(2000.7.25)

| (51) Int.Cl. ⁷ | | 識別記号 | | FΙ | | | | | テーマコート*(参考) |
|---------------------------|--------|------|-------------|-----|--------|------|----|----------|-------------|
| B01J | 31/22 | | | B 0 | 1 J 31 | /22 | | Z | 4G069 |
| C07C | 2/32 | | | C 0 | 7 C 2 | /32 | | | 4H006 |
| | 11/107 | | | | 11 | /107 | | | 4H039 |
| C08F | 4/60 | | | C 0 | 8F 4 | /60 | | | 4J028 |
| | 110/02 | | | | 110 | /02 | | | |
| | | • | 家查請求 | 未請求 | 請求項 | の数 7 | OL | (全 17 頁) | 最終頁に続く |

(21) 出願番号 特願平11-11493 (71) 出願人 000003300 東ソー株式会社 山口県新南陽市開成町4560番地 (72)発明者 小栗 元宏 三重県四日市市別名6丁目7-8 (72)発明者 三村 英之 三重県四日市市別名3丁目5-1 (72)発明者 岡田 久則 三重県四日市市垂坂町366-1

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びこれを用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。

【解決手段】 中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物の少なくとも3成分からなる触媒を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】中性の多座配位子が配位したクロム錯体、 アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティッ クな還元反応生成物の少なくとも3成分からなるエチレ ンの三量化触媒。

【請求項2】電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物が、塩類処理、酸処理及び/又はルイス塩基処理をしたものであることを特徴とする請求項1に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項3】中性の多座配位子が配位したクロム錯体が、下記一般式(1)

 $ACrB_{0}$ (1)

(式中、Aは中性の多座配位子である。nは1~3の整数であり、Bは水素原子、炭素数1~10の炭化水素基、カルボキシレート基もしくはジケトナート基、ハロゲン原子、アミド、イミド、アルコキシド、チオアルコキシド、カルボニル、アレーン、アルケン、アルキン、アミン、イミン、ニトリル、イソニトリル、ホスフィンオキシド、ホスファイト、エーテル、スルホン、スルホキシド及びスルフィドからなる群より選びれる1種以上を表す)で示される錯体であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項4】中性の多座配位子が三脚型構造を有することを特徴とする請求項1乃至請求項3に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】中性の多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることを特徴とする請求項1乃至請求項4に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項6】アルキル金属化合物が、下記一般式(2) R, MX。 (2)

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≦q<3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す)で示される化合物であることを特徴とする請求項1乃至請求項5に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項7】請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の 40 エチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化す ることを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。 さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン (LLDPE) の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関 50

する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、特定の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒を用いることは公知である。例えば、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ポリアミン又はヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという問題があった。また、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低く、工業的な観点から十分なものではなかった。また、特開平10-231317号公報に記載の方法も触媒活性は低いものであった。さらに、選択性に関しても1-ヘキセンよりもポリエチレンの生成が多いばかりか、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠点があった。

【0004】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、LLDPEの原料コモノマーとして有用な1ーヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造することができるエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法を提供することである。

[0005]

30

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化触媒を用いると高い活性でエチレンの三量化反応が進行し、高選択的に1ーヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0006】即ち本発明は、中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物の少なくとも3成分からなるエチレンの三量化触媒とこれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】次に、本発明についてさらに詳し く説明する。

【0008】本発明によれば、エチレンの三量化触媒を構成する一成分として、電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物が用いられる。

【0009】本発明における電子移動を伴うトポタクティックな還元反応とは、R. Schollhornが、

Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1 9.983-1003(1980)で定義しているよう に、ホスト化合物が電子を得て還元され、電荷のバラン スを取るためにゲストカチオンがホスト化合物中の空の*

$$x E^{+} + x e^{-} + \square [Q] \rightarrow$$

[式中、[Q] はホスト化合物であり、□は[Q]中の 空の格子サイトであり、e は電子であり、x は還元量 であり、E[・]は1価のゲストカチオンである] により例 示することができる。

$$(E^{+}_{a} + E^{2+}_{b/2} + E^{3+}_{c/3} + E^{4+}_{c/4} + E^{5+}_{c/6})$$

 $E^{9+}_{i/9} + E^{10+}_{j/10}) (L^{2})_{b} [Q]^{b-}_{c}$

「式中、「Q」はホスト化合物であり、kは還元量であ る。またEはゲストカチオンであり、a+b+c+d+ e+f+g+h+i+j=k である。 さらに L^* はルイ ス塩基であり、hはルイス塩基量である]で表される化 合物を例示することができる。

【0011】ここで、[Q] としては、3次元構造を有 するホスト化合物、2次元構造を有するホスト化合物、 1次元構造を有するホスト化合物及び分子性固体である ホスト化合物を例示することができる。

【0012】3次元構造を有するホスト化合物として は、特に限定されるものではないが、例えば、八硫化六 モリブデン、八セレン化六モリブデン、四硫化三モリブ デン、四硫化三チタン、八セレン化六チタン、四硫化三 ニオブ、八硫化六バナジウム、八硫化五バナジウム、五 酸化二バナジウム、三酸化タングステン、二酸化チタ ン、二酸化バナジウム、二酸化クロム、二酸化マンガ ン、二酸化タングステン、二酸化ルテニウム、二酸化オ スミウム、二酸化イリジウムを例示することができる。 【0013】2次元構造を有するホスト化合物として は、特に限定されるものではないが、例えば、二硫化チ タン、二硫化ジルコニウム、二硫化ハフニウム、二硫化 バナジウム、二硫化ニオブ、二硫化タンタル、二硫化ク ロム、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、二硫化 レニウム、二硫化白金、二硫化スズ、二硫化鉛、二セレ ン化チタン、ニセレン化ジルコニウム、ニセレン化ハフ ニウム、ニセレン化バナジウム、ニセレン化ニオブ、ニ セレン化タンタル、ニセレン化クロム、ニセレン化モリ ブデン、ニセレン化タングステン、ニセレン化レニウ ム、ニセレン化白金、ニセレン化スズ、ニセレン化鉛、 ニテルル化チタン、ニテルル化ジルコニウム、ニテルル 化ハフニウム、ニテルル化バナジウム、ニテルル化ニオ ブ、ニテルル化タンタル、ニテルル化クロム、ニテルル 化モリブデン、ニテルル化タングステン、ニテルル化レ ニウム、ニテルル化白金、ニテルル化スズ、ニテルル化 鉛、三硫化リンマグネシウム、三硫化リンカルシウム、 三硫化リンバナジウム、三硫化リンマンガン、三硫化リ ン鉄、三硫化リンコバルト、三硫化リンニッケル、三硫 化リンパラジウム、三硫化リン亜鉛、三硫化リンカドミ ウム、三硫化リン水銀、三硫化リンスズ、三セレン化リ 50

* 格子サイトに取り込まれる反応であり、しかも、反応前 後でホスト化合物の構造及び組成が何ら変化しない反応 である。この反応は、一般式(3)

$$(E'), [Q]''$$
 (3)

※【0010】本発明における電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応生成物は、上記の電子移動を伴うトポ タクティックな還元反応の生成物であり、一般式 (4)

$$(E^{1} + E^{2} + E^{3} + E^{3} + E^{4} + E^{4} + E^{5} + E^{5} + E^{6} + E^{7} + E^{7} + E^{8} + E^{8} + E^{10} + E^{1$$

ンマグネシウム、三セレン化リンカルシウム、三セレン 化リンバナジウム、三セレン化リンマンガン、三セレン 化リン鉄、三セレン化リンコバルト、三セレン化リンニ ッケル、三セレン化リンパラジウム、三セレン化リン亜 鉛、三セレン化リンカドミウム、三セレン化リン水銀、 三セレン化リンスズ、四硫化リンクロム、タンタルスル フィドカーバイド、三酸化モリブデン、五十二酸化十八 モリブデン、五酸化バナジウムゲル、オキシ塩化鉄、オ キシ塩化チタン、オキシ塩化バナジウム、オキシ塩化グ ロム、オキシ塩化アルミニウム、オキシ塩化ビスマス、 α - 窒化塩化ジルコニウム、 β - 窒化塩化ジルコニウ ム、α-窒化臭化ジルコニウム、β-窒化臭化ジルコニ ウム、窒化ヨウ化ジルコニウム、窒化塩化チタン、窒化 臭化チタン、窒化ヨウ化チタン、グラファイト、ポリア センを例示することができる。

【0014】1次元構造を有するホスト化合物として は、特に限定されるものではないが、例えば、三硫化チ タン、三セレン化ニオブ、二硫化鉄カリウム、ポリアセ チレン、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェ ン、ポリ (p-フェニレン)、ポリ (トリフェニレ) ン)、ポリアズレン、ポリフルオレン、ポリナフタレ ン、ポリアントラセン、ポリフラン、ポリカルバゾー ル、テトラチオフルバレン置換ポリスチレン、フェロセ ン置換ポリエチレン、カルバゾール置換ポリエチレン、 ポリオキシフェナジンを例示することができる。

【0015】分子性固体であるホスト化合物としては、 特に限定されるものではないが、例えば、テトラシアノ キノジメタン、テトラチオフルバレンを例示することが 40 できる。

【0016】さらに、[Q]としては、上記ホスト化合 物を複数混合して用いることもできる。

【0017】kは特に限定はないが、高い触媒活性でエ チレンの三量化を行うことを目的に、好ましくはO<k ≦3の範囲を用いることができる。さらに好ましくは0 < k ≤ 2の範囲を用いることができる。

【0018】以下においては、上記一般式(4)のE・ からE^{10*} を簡便のため総称してE^{T*}と表記する。ここ で、nは1~10の整数である。

【0019】一般式(4)のL'としては、E"に配位

するルイス塩基を用いることができる。ルイス塩基は、 特に限定されるものではないが、例えば、水、アミン化 合物、窒素を含む複素環化合物、エチルエーテルもしく はn-ブチルエーテル等のエーテル類、ホルムアミド、 N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミ ドもしくはN-メチルアセトアミド等のアミド類、メチ ルアルコールもしくはエチルアルコール等のアルコール 類、1、2-ブタンジオール、1、3-ブタンジオー ル、1、4-ブタンジオールもしくは2、3-ブタンジ オール等のジオール類、グリセリン、ポリ (エチレング 10 リコール)、ジグライム、1,2-ジメトキシエタン、 リン酸トリメチル、ヘキサメチルホスホルアミド、トリ -n-ブチルリンオキサイド、1,4-ジオキサン、ア セトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォ キシド又は炭酸プロピレンを例示することができるが、 これら2種以上を混合して用いることもできる。

【0020】hは0≦h≦10の範囲を用いることができる。

【0021】上記一般式 (4) の E^{**} としては、周期表 $1\sim14$ 族の原子からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の原子を含むカチオンを用いることができる。高い触媒活性でエチレンの三量化を行うことを目的に、好ましくは、一般式 (5)、(6)、(7)又は (8) $R^{'}_{2}R^{^{2}}NH^{^{2}}$ (5)

[式中、R¹2 R² Nはアミン化合物であり、R¹ は各々独立して水素原子又は炭素数 1 ~ 3 0 の脂肪族炭化水素基であり、R² は水素原子、炭素数 1 ~ 3 0 の脂肪族炭化水素基又は炭素数 1 ~ 5 0 の芳香族炭化水素基である] T¹ H² (6)

[式中、T¹は窒素を含む複素環化合物である] (R³) (7)

[式中、 (R^3) は炭素数 $1\sim50$ のカルボニウムカチオン又はトロピリウムカチオンである] $G^{"}$ (8)

[式中、Gは周期表 $1 \sim 14$ 族の原子からなる群より選ばれる少なくとも 1種の原子、又はシクロペンタジエニル基が置換した金属原子であり、 G^{m} は n 価のカチオンである] で表されるカチオンが用いられる。これらのカチオンは、それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を用いることも可能である。

【0022】 R^{-1} 2 R^{2} Nで表されるアミン化合物は、特に限定されるものではないが、例えば、メチルアミン、エチルアミン、n-プロピルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、イソブチルアミン、t-ブチルアミン、アリルアミン、シクロペンチルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジアリルアミン、トリメチルアミン、トリーn-ブチルアミン、トリアリルアミン、n-ブチルアミン、n-ブチルアミン、n-ブチルアミン、n-

アミン、tーオクチルアミン、ノニルアミン、デシルア ミン、ウンデシルアミン、ドデシルアミン、トリデシル アミン、テトラデシルアミン、ペンタデシルアミン、ヘ キサデシルアミン、ヘプタデシルアミン、オクタデシル アミン、ノナデシルアミン、シクロヘキシルアミン、シ クロヘプチルアミン、シクロヘキサンメチルアミン、2 ーメチルシクロヘキシルアミン、4-メチルシクロヘキ シルアミン、2,3-ジメチルシクロヘキシルアミン、 シクロドデシルアミン、2-(1-シクロヘキセニル) エチルアミン、ゲラニルアミン、N-メチルヘキシルア ミン、ジヘキシルアミン、ビス (2-エチルヘキシル) アミン、ジオクチルアミン、ジデシルアミン、ジドデシ ルアミン、ジテトラデシルアミン、ジヘキサデシルアミ ン、ジオクタデシルアミン、N-メチルシクロヘキシル アミン、Nーエチルシクロヘキシルアミン、Nーイソプ ロピルシクロヘキシルアミン、N-t-ブチルシクロヘ キシルアミン、N-アリルシクロヘキシルアミン、N, N-ジメチルオクチルアミン、N, N-ジメチルウンデ シルアミン、N、N-ジメチルドデシルアミン、N、N ージメチルオクタデシルアミン、N, N-ジオクタデシ ルメチルアミン、N, N-ジオレイルメチルアミン、ト リヘキシルアミン、トリイソオクチルアミン、トリオク チルアミン、トリイソデシルアミン、トリドデシルアミ ン、N、Nージメチルシクロヘキシルアミン、N、Nー ジエチルシクロヘキシルアミン等の脂肪族アミン類、ア ニリン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N -アリルアニリン、o-トルイジン、m-トルイジン、 p-トルイジン、N, N-ジメチルアニリン、N-メチ ルーoートルイジン、Nーメチルーmートルイジン、N 30 -メチル-p-トルイジン、N-エチル-o-トルイジ ン、N-エチル-m-トルイジン、N-エチル-p-ト ルイジン、N-アリルーo-トルイジン、N-アリルー m-トルイジン、N-アリル-p-トルイジン、N-プ ロピルーoートルイジン、Nープロピルーmートルイジ ン、N-プロピルーp-トルイジン、2,3-ジメチル アニリン、2, 4-ジメチルアニリン、2, 5-ジメチ ルアニリン、2,6ージメチルアニリン、3,4ージメ チルアニリン、3、5-ジメチルアニリン、2-エチル アニリン、3-エチルアニリン、4-エチルアニリン、 40 N. N-ジエチルアニリン、2-イソプロピルアニリ ン、4-イソプロピルアニリン、2-t-ブチルアニリ ン、4-n-ブチルアニリン、4-s-ブチルアニリ ン、4-t-ブチルアニリン、2,6-ジエチルアニリ ン、2-イソプロピルー6-メチルアニリン、2-クロ ロアニリン、3-クロロアニリン、4-クロロアニリ ン、2-ブロモアニリン、3-ブロモアニリン、4-ブ ロモアニリン、oーアニシジン、mーアニシジン、pー アニシジン、o-フェネチジン、m-フェネチジン、p ーフェネチジン、1ーアミノナフタレン、2ーアミノナ フタレン、1ーアミノフルオレン、2ーアミノフルオレ ン、3-アミノフルオレン、4-アミノフルオレン、5 ーアミノインデン、2ーアミノビフェニル、4ーアミノ ビフェニル、N, 2, 3-トリメチルアニリン、N, 2, 4-トリメチルアニリン、N, 2, 5-トリメチル アニリン、N, 2, 6-トリメチルアニリン、N, 3, 4-トリメチルアニリン、N, 3, 5-トリメチルアニ リン、N-メチル-2-エチルアニリン、N-メチルー 3-エチルアニリン、N-メチル-4-エチルアニリ ン、N-メチルー6-エチルーo-トルイジン、N-メ チルー2-イソプロピルアニリン、N-メチルー4-イ ソプロピルアニリン、N-メチル-2-t-ブチルアニ リン、N-メチルー4-n-ブチルアニリン、N-メチ $\nu-4-s-7$ $+\nu-4-t$. ブチルアニリン、N-メチル-2、6-ジエチルアニリ ン、N-メチル-2-イソプロピル-6-メチルアニリ ン、N-メチル-p-アニシジン、N-エチル-2, 3 -アニシジン、N、N-ジメチル-o-トルイジン、 N, N-ジメチル-m-トルイジン、N, N-ジメチル -p-トルイジン、N, N, 2, 3-テトラメチルアニ リン、N, N, 2, 4-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 5-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 6-テトラメチルアニリン、N, N, 3, 4-テトラメチル アニリン、N, N, 3, 5-テトラメチルアニリン、 N, N-ジメチル-2-エチルアニリン、N, N-ジメ チルー3-エチルアニリン、N, N-ジメチルー4-エ チルアニリン、N, N-ジメチル-6-エチル-o-ト ルイジン、N, N-ジメチル-2-イソプロピルアニリ ン、N, N-ジメチル-4-イソプロピルアニリン、 N, N-ii \forall x+v+ジメチルー4-n-ブチルアニリン、N, N-ジメチル 30 -4-s-ブチルアニリン、N, N-ジメチル-4-t ーブチルアニリン、N, N-ジメチル-2, 6-ジエチ ルアニリン、N, N-ジメチル-2-イソプロピル-6 -メチルアニリン、N, N-ジメチル-2-クロロアニ リン、N, N-ジメチル-3-クロロアニリン、N, N -ジメチル-4-クロロアニリン、N, N-ジメチルー 2-ブロモアニリン、N, N-ジメチル-3-ブロモア ニリン、N, Nージメチルー4ーブロモアニリン、N, N-ジメチルーo-アニシジン、N, N-ジメチルーm ーアニシジン、N, N-ジメチルーpーアニシジン、 N, N-ジメチル-o-フェネチジン、N, N-ジメチ ルーm-フェネチジン、N, N-ジメチル-p-フェネ チジン、N、Nージメチルー1-アミノナフタレン、 N, N-ジメチル-2-アミノナフタレン、N, N-ジ メチル-1-アミノフルオレン、N、N-ジメチル-2 -アミノフルオレン、N, N-ジメチル-3-アミノフ

* チルー2-アミノビフェニル、N, N-ジメチルー4-アミノビフェニル、N、Nージメチルーpートリメチル シリルアニリン等の芳香族アミン類を例示することがで

8

【0023】T¹で表される窒素を含む複素環化合物 は、特に限定されるものではないが、例えば、オキサゾ ール、イソオキサゾール、チアゾール、イソチアゾー ル、イミダゾール、ピラゾール、フラザン、ピリジン、 ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、ピロリン、ピロリ ジン、イミダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾリン、ピ ラゾリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリン、ピ コリン、コリジン、インドール、イソインドール、イン ダゾール、キノリン、イソキノリン、シンノリン、キナ ゾリン、キノキサリン、フタラジン、プリン、プテリジ ン、カルバゾール、フェナントリジン、アクリジン、フ ェナジン、フェナントロリン、インドリン、イソインド リン、2,5-ジメチルピロリジン、2-メチルピペリ ジン、3-メチルピペリジン、4-メチルピペリジン、 2, 6-ジメチルピペリジン、3, 3-ジメチルピペリ ジン、3,5ージメチルピペリジン、2-エチルピペリ ジン、2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリジン、1ー メチルピロリジン、1-メチルピペリジン、1-エチル ピペリジン、1 -ブチルピロリジン、1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルピペリジンを例示することができる。 【0024】一般式(7)で表されるカチオンは、特に 限定されるものではないが、例えば、トリフェニルメチ ルカチオン、トロピリウムカチオンを例示することがで きる。

【0025】一般式(8)で表されるカチオンは、特に 限定されるものではないが、例えば、水素原子、リチウ ム原子、ナトリウム原子、カリウム原子、ルビジウム原 子、セシウム原子、ベリリウム原子、マグネシウム原 子、カルシウム原子、ストロンチウム原子、バリウム原 子、チタン原子、ジルコニウム原子、ハフニウム原子、 ニオブ原子、タンタル原子、クロム原子、鉄原子、ニッ ケル原子、銅原子、銀原子、亜鉛原子、アルミニウム原 子、スズ原子のカチオンを例示することができる。ま た、シクロペンタジエニル基が置換した金属原子は、特 に限定されるものではないが、例えば、フェロセニウ ム、デカメチルフェロセニウム等を例示することができ 40

【0026】本発明における電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応生成物の具体的な調製方法としては特 に限定がないが、(a)ゲストカチオンになる原子の液 体アンモニア溶液にホスト化合物を浸す方法 [式

(9)]、

[0027]

[4k.1]

(k/n)C + [Q] \rightarrow ((k/n) G * ' + k c ⁻(N H ₃) + [Q]) — $\rightarrow G_a^{\alpha\alpha}(NH^3)^p[\delta],$ (3)

ルオレン、N, N-ジメチル-4-アミノフルオレン、

```
特開2000-202299
                      \Rightarrow \{(k/n)G^{**} + ke^{-} + \{Q\}\} \longrightarrow G^{**}_{\alpha\omega}[Q]^{k}
                              \rightarrow ((k/n) G^{**} + ke^{*} + [Q]) \longrightarrow G^{**}_{avo}[Q]^{*} \quad (11)
\longrightarrow [(k/n)G^{*} + ke^{-} + [Q] + h(H_{*}O)] \longrightarrow G''_{k/k}(H_{*}O)_{*}[Q]^{*}
                                         30* て、ゲストカチオンになる原子を含むアノードを用いて
```

```
【0038】 [式中、Solv<sup>2</sup>は水又は非水溶媒であ
                                 電気化学的に還元を行う方法[式(15)]、
る]
                                 [0039]
(g) ホスト化合物をカソードとして、ゲストカチオン
                                  【化7】
を含むアノードを用いて電気化学的に還元を行う方法
[式 (14)]、(h) ホスト化合物をカソードとし *
```

 \rightarrow ((k/n)G*' + ke + [Q] + b(Soly')) ---

% [0041] 【0040】(i)アミン化合物とホスト化合物を10 ※ 【化8】 0~1500℃で反応させる方法[式(16)]、 $\{k(T^2)H^* + ke^* + [Q] + hT^*\} \longrightarrow \{(T^i)H^i\}_i(T^i)_i[Q]^{i_i}$ (16)

【0042】 [式中、T²はアミン化合物である] **★** [0043] (j) 窒素を含む複素環化合物とホスト化合物を100 ~1500℃で反応させる方法[式(17)]、

$$[Q] \longrightarrow (k(T')H^* + ke + [Q] + hT') \longrightarrow ((T')H']_*(T')_*[Q]^{c}$$

$$\Delta$$

(6)

★ [0033]

☆ [式(13)]、 [0035]

(14)], [0037]

【化6】

【0028】(b) ゲストカチオンになる原子とホスト *【0029】

【0030】(c) ゲストカチオンのハロゲン化物とホ ※【0031】

化合物を100~1500℃で反応させる方法[式(1

スト化合物を100~1500℃で反応させる方法[式

【0032】 [式中、X はハロゲン原子である] (d) 還元試薬の非水溶媒溶液に、ホスト化合物を浸す

【0034】 [式中、Red゚はG[™] を含む還元試薬で

【0036】 [式中、Red²はG²²を含む還元試薬で

(f) ホスト化合物をカソードとして、ゲストカチオン を含む電解質溶液中で電気化学的に還元を行う方法[式◆

(e) 還元試薬の水溶液に、ホスト化合物を浸す方法 ☆20 【化5】

あり、Solv¹は非水溶媒である]

0)],

(11)],

ある]

方法[式(12)]、

えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタ 【0044】を例示することができる。 【0045】方法(d)、(f)、(g)及び(h)に ン、ノナン、デカン、シクロペンタンもしくはシクロへ おける非水溶媒は、特に限定されるものではないが、例 50 キサン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエンもし

30

くはキシレン等の芳香族炭化水素類、エチルエーテルもしくはnーブチルエーテル等のエーテル類、塩化メチレンもしくはクロロホルム等のハロゲン化炭化水素類、ホルムアミド、NーメチルホルムアミドもしくはNーメチルアセトアミド等のアミド類、メチルアルコールもしくはエチルアルコール等のアルコール類、1,2ーブタンジオール、1,3ーブタンジオール、1,4ーブタンジオールもしくは2,3ーブタンジオール等のジオール類、グリセリン、ポリーブタンジオール等のジオール類、グリセリン、ポリーブタンジオール等のジオール類、グリセリン、ポリーブタンジオールがリコール)、ジグライム、1,2ージメトキシエタン、リン酸トリメチル、ヘキサメチルホスルアミド、トリーnーブチルリンオキサイド、1,4ージオキサン、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォキシド又は炭酸プロピレンを例示すること

11

【0046】方法(c)に関しては、ゲストカチオンのハロゲン化物として、特に限定されるものではないが、例えば、塩化リチウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化ルビジウム、塩化セシウムを例示することができる。

ができる。

【0047】方法(d)に関しては、還元試薬として、特に限定されるものではないが、例えば、nープチルリチウム、ナフタレンナトリウム、ベンゾフェノンリチウム、ベンゾフェノンナトリウム、ョウ化リチウムを例示することができ、0.001~10mol/lの濃度で、ホスト化合物1molに対して0.001~10mol用いることができる。反応温度は特に限定はないが、−100~100℃を用いることができ、反応時間に関しても特に限定はないが、1分~60日を用いることができる。

【0048】方法(e)に関して、還元試薬は特に限定 されるものではないが、例えば、亜二チオン酸ナトリウ ム、水素化ホウ素ナトリウム、硫化ナトリウムを例示す ることができ、0.001~10mol/lの濃度で、 ホスト化合物 1 m o l に対して 0. 0 0 1 ~ 1 0 m o l 用いることができる。反応温度は特に限定はないが、〇 ~100℃を用いることができ、反応時間に関しても特 に限定はないが、1分~60日を用いることができる。 【0049】方法(f)に関して、電解質は特に限定さ れるものではないが、例えば、ゲストカチオンの塩酸 塩、リン酸塩、硫酸塩、硝酸塩、炭酸塩、過塩素酸塩、 ギ酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、シュウ酸塩、マロン 酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、テトラフルオロホウ酸 塩及びヘキサフルオロリン酸塩を例示することができ、 0.001~10mol/lの濃度で用いることができ る。

【0050】方法(g)に関して、アノードは特に限定されるものではないが、例えば、グラファイトのアルカリ金属塩を例示することができる。

【0051】方法(h)に関して、アノードは特に限定 50

されるものではないが、例えば、リチウムを例示することができる。

【0052】方法(i)に関して、アミン化合物は特に限定されるものではないが、例えば、アンモニア、前記 R^{1} 2 R^{2} Nで表されるアミン化合物を例示することができる。

【0053】さらに、本発明における電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物は、必要に応じて塩類処理、酸処理及び/又はルイス塩基処理して用いることもできる。

【0054】塩類処理に用いられる塩類は、周期表1~14族の原子からなる群より選ばれる少なくとも一種の原子を含む陽イオンと、ハロゲン原子、無機酸又は有機酸の陰イオンからなる群より選ばれる少なくとも一種の陰イオンとからなる化合物であり、好ましくは、一般式(5)、(6)、(7)又は(8)で表される陽イオンからなる群より選ばれる少なくとも一種の陽イオンと、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、リンで破、が破、硝酸、炭酸、過塩素酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、クエン酸、ヤチルアセトン、テトラフルオロホウ酸及びヘキサフルオロリン酸の陰イオンからなる群より選ばれる少なくとも一種の陰イオンとからなる化合物である。

【0055】一般式(5)で表される陽イオンと、塩素原子の陰イオンとからなる塩類としては、特に限定されるものではないが、例えば、前記R¹2R²Nで表されるアミン化合物の塩酸塩を例示することができる。

【0056】一般式(6)で表される陽イオンと、塩素原子の陰イオンとからなる塩類としては、特に限定されるものではないが、例えば、前記T[†]で表される窒素を含む複素環化合物の塩酸塩を例示することができる。

【0057】一般式(7)で表される陽イオンと、ハロゲン原子の陰イオンとからなる塩類としては、特に限定されるものではないが、例えば、塩化トリフェニルメチル、臭化トロピリウムを例示することができる。

【0058】一般式(8)で表される陽イオンを含む塩類としては、特に限定されるものではないが、例えば、塩化リチウム、塩化ナトリウム、リン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、硝酸ナトリウム、ギ酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、塩化ルビジウム、塩化セシウム、塩化センウム、塩化マグネシウム、リン酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、強化カルシウム、塩化ガルシウム、塩化ガルシウム、塩化ガルシウム、塩化ガルシウム、塩化ガル、塩化ガル、塩化ガル、塩化ガル、塩化ガル、塩化チタン、塩化カル、塩化チタン、塩化カル、塩化カル、塩化サタン、塩化コニウム、塩化ニッケル、塩化銀、塩化銀、塩化アルミニウム、リン酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、砂え、流酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、ジュウ酸ア

ルミニウム、塩化スズ、フェロセニウム硫酸塩を例示す ることができる。

13

【0059】酸処理に用いられる酸としては、特に限定 されるものではないが、例えば、塩酸、リン酸、硫酸、 硝酸、炭酸、過塩素酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、シ ュウ酸、マロン酸、コハク酸、クエン酸を例示すること ができるが、2種以上混合して用いることもできる。

【0060】ルイス塩基処理に用いられるルイス塩基と しては、特に限定されるものではないが、例えば、水、 NH₃、前記R¹2R²Nで表されるアミン化合物、前記T で表される窒素を含む複素環化合物、エチルエーテル もしくはn-ブチルエーテル等のエーテル類、ホルムア ミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホル ムアミドもしくはN-メチルアセトアミド等のアミド 類、メチルアルコールもしくはエチルアルコール等のア ルコール類、1,2-ブタンジオール、1,3-ブタン ジオール、1、4ーブタンジオールもしくは2、3ーブ タンジオール等のジオール類、グリセリン、ポリ(エチ レングリコール)、ジグライム、1,2-ジメトキシエ タン、リン酸トリメチル、ヘキサメチルホスホルアミ ド、トリーnーブチルリンオキサイド、1,4ージオキ サン、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチル スルフォキシド又は炭酸プロピレンを例示することがで きるが、2種以上混合して用いることもできる。

【0061】塩類処理、酸処理及び/又はルイス塩基処 理の方法としては、塩類、酸及び/又はルイス塩基に、 又は塩類、酸及び/又はルイス塩基を溶解させた溶液 に、方法(a)~(j)の還元反応で得られた生成物か らなる群より選ばれる少なくとも1種の還元反応生成物 を浸す方法を例示することができる。

【0062】塩類処理と酸処理とルイス塩基処理を組み 合わせる場合においては、塩類処理を行った後、酸処理 を行う方法、塩類処理を行った後、ルイス塩基処理を行 う方法、酸処理を行った後、塩類処理を行う方法、酸処 理を行った後、ルイス塩基処理を行う方法、ルイス塩基 処理を行った後、塩類処理を行う方法、ルイス塩基処理 を行った後、酸処理を行う方法、塩類処理と酸処理を同 時に行う方法、塩類処理とルイス塩基処理を同時に行う 方法、酸処理とルイス塩基処理を同時に行う方法、塩類 処理を行った後、酸処理とルイス塩基処理を同時に行う 方法、酸処理を行った後、塩類処理とルイス塩基処理を 同時に行う方法、ルイス塩基処理を行った後、塩類処理 と酸処理を同時に行う方法、塩類処理と酸処理を同時に 行った後、ルイス塩基処理を行う方法、塩類処理とルイ ス塩基処理を同時に行った後、酸処理を行う方法、酸処 理とルイス塩基処理を同時に行った後、塩類処理を行う 方法、及び塩類処理と酸処理とルイス塩基処理を同時に 行う方法を用いることができる。

【0063】塩類、酸及びルイス塩基による処理条件は 特に限定はないが、塩類、酸及びルイス塩基は、O. O 50 ~ 6 の整数である。D はそれぞれ独立して置換基を有

01~10mol/lの濃度で、還元反応生成物中のゲ ストカチオン1molに対して0.001~1000m ol、処理温度は-100~150°C、処理時間は1分 ~60日の条件を選択することが好ましい。また、これ らの処理は、必要に応じて繰り返し行ってもよい。

【0064】塩類処理、酸処理及び/又はルイス塩基処 理に用いられる溶媒としては、ブタン、ペンタン、ヘキ サン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロペ ンタンもしくはシクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類、 ベンゼン、トルエンもしくはキシレン等の芳香族炭化水 10 素類、メチルアルコールもしくはエチルアルコール等の アルコール類、エチルエーテルもしくはn-ブチルエー テル等のエーテル類、塩化メチレンもしくはクロロホル ム等のハロゲン化炭化水素類、1,4-ジオキサン、ア セトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォ キシド、水炭酸プロピレン又はアンモニア水を例示する ことができるが、これらの溶媒は複数混合して用いるこ ともできる。

【0065】本発明において電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応生成物の使用量は、特に制限されるも のではないが、後記のクロム錯体1モルに対して0.0 1~10000kgであり、好ましくは0.1~100 0kg、より好ましくは1~500kgである。

【0066】本発明において、エチレンの三量化触媒を 構成する一成分として、中性の多座配位子が配位したク ロム錯体が用いられる。中性の多座配位子が配位したク ロム錯体は、下記一般式(1)

$$ACrB_n$$
 (1)

(式中、Aは中性の多座配位子である。nは1~3の整 数であり、Bは水素原子、炭素数1~10の炭化水素 基、カルボキシレート基もしくはジケトナート基、ハロ ゲン原子、アミド、イミド、アルコキシド、チオアルコ キシド、カルボニル、アレーン、アルケン、アルキン、 アミン、イミン、ニトリル、イソニトリル、ホスフィ ン、ホスフィンオキシド、ホスファイト、エーテル、ス ルホン、スルホキシド及びスルフィドからなる群より選 ばれる1種以上を表す)で示される錯体が好適なものと して挙げられる。

【0067】ここで、クロム錯体に配位させる中性の多 座配位子として用いられるものは、特に限定されるもの ではないが、例えば、下記一般式(18)

[0068]

【化10】

$$G = \begin{bmatrix} D_a^1 - L^1 \\ D_b^1 - L^1 \end{bmatrix}$$
 (18)

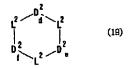
【0069】(式中、a, b, cはそれぞれ独立した0

していてもよい 2 価の炭化水素基、 L^1 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよいヘテロ元素基又は複素環式化合物を表す。また、G は炭化水素、ケイ素、窒素又はリンを表す)で示される三脚型構造を有する多座配位子、下記一般式(19)

15

[0070]

【化11】



【0071】(式中、d, e, fはそれぞれ独立した1~6の整数である。D²はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L²はそれぞれ独立して置換基を有していてもよいヘテロ元素基を表す)で示される環状型構造を有する多座配位子及び下記一般式(20)

[0072]

【化12】

$$\begin{bmatrix}
D_{a}^{1} & D_{a}^{1} \\
D_{a}^{1} & D_{a}^{1}
\end{bmatrix}$$
(20)

【0073】(式中、g, hはそれぞれ独立した0~6の整数である。D³はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L³はそれぞれ独立して置換基を有していてもよいヘテロ元素基又は複素環式化合物を表す)で示されるブリッジ型構造を有する多座配位子等が挙げられる。

【0074】上記一般式(18)、(19)及び(20)において、D'、D'及びD'は、特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基類等が挙げられる。

【0075】一般式 (18)、 (19)及び (20)において、L¹、L²及びL³で示されるヘテロ元素基は、特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ 40基類、フェノキシ基類、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基等のアルキルチオ基域、フェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類、フェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジスチルアミノ基等のジアルキルアミノ基類、ジフェニルアミノ基等のジアリールアミノ基類、メチルフェニル基等のアルキルアリールアミノ基類、ジメチルカスフィノ基、ジフェニルホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基、50

等のジアリールホスフィノ基、メチルフェニルホスフィノ基等のアルキルアリールホスフィノ基類が挙げられる。

【0076】また、一般式(18)及び(20)において、L¹及びL²で示される複素環式化合物は、特に限定されるものではないが、例えば、フリル基、ベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、テトラゾリル基、ピリジル基、イミダゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、インダゾリル基、キ10 ノリル基、イソキノリル基、オキサゾリル基、チアゾール基等が挙げられる。これらのヘテロ元素基及び複素環式化合物の置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

【0077】上記一般式 (18) におけるGとしては、 特に限定されるものではないが、例えば、メタン、エタ ン、プロパン、ブタン、ヒドロキシメタン、メチルシラ ン、フェニルシラン、アミン、アミンオキシド、ホスフィン、ホスフィンオキシド等が挙げられる。

【0078】上記一般式(18)で示される三脚型構造 を有する多座配位子として通常用いられるものは、特に 限定されるものではないが、例えば、トリス(メトキシ メチル)メタン、1、1、1ートリス(メトキシメチ ル) エタン、1、1、1-トリス(メトキシメチル)プ ロパン、1, 1, 1-トリス(メトキシメチル)ブタ ン、1,1,1-トリス(エトキシメチル)エタン、 1, 1, 1ートリス (プロポキシメチル) エタン、1, 1, 1-トリス (ブトキシメチル) エタン、1, 1, 1 ートリス (フェノキシメチル) エタン、トリフリルメタ 30 ン、トリス (5-メチルー2-フリル) メタン、トリス (5-エチルー2-フリル) メタン、トリス (5-ブチ ルー2-フリル)メタン、1,1,1-トリフリルエタ ン、トリフリルアミン、トリフリルホスフィン、トリフ リルホスフィンオキシド等の含酸素多座配位子類、1, 1, 1-トリス (メチルチオメチル) エタン、1, 1, 1-トリス (ブチルチオメチル) エタン、1, 1, 1-トリス (フェニルチオメチル) エタン、トリス (チエニ ル) メタン等の含イオウ多座配位子類、1, 1, 1ート リス(ジメチルアミノメチル)エタン、1,1,1-ト リス (ジフェニルアミノメチル) エタン、トリス (ピラ ゾリル) メタン、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラ ゾリル) メタン、トリス(3,5-ジイソプロピルー1 ーピラゾリル) メタン、1, 1, 1ートリス(3, 5ー ジメチルー1ーピラゾリル) エタン、1, 1, 1ートリ ス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)プロパン、 1, 1, 1ートリス (3, 5ージメチルー1ーピラゾリ ル) ブタン、トリス (2-ピリジル) メタン、トリス (6-メチルー2-ピリジル)メタン、トリス(2-ピ リジル)アミン、トリス(2ーピリジル)ホスフィン、

トリス (2-ピリジル) ホスフィンオキシド、トリス

(2-ピリジル) ヒドロキシメタン、トリス (1-イミダゾリル) メタン等の含窒素多座配位子類、1, 1, 1-トリス (ジフェニルホスフィノメチル) エタン、1, 1-トリス (ジメチルホスフィノメチル) エタン、1, 1, 1-トリス (ジエチルホスフィノメチル) エタン等の含リン多座配位子類が挙げられる。

【0079】また、環状型構造を有する多座配位子とし ては、特に限定されるものではないが、例えば、1, 3, 5-トリメチルー1, 3, 5-トリアザシクロヘキ サン、1, 3, 5-トリエチル-1, 3, 5-トリアザ 10 シクロヘキサン、1,3,5-トリーi-プロピルー 1, 3, 5ートリアザシクロヘキサン、1, 3, 5ート y-t-7+v-1, 3, 5-byン、1, 3, 5ートリーnーブチルー1, 3, 5ートリ アザシクロヘキサン、1,3,5-トリシクロヘキシル -1, 3, 5-トリアザシクロヘキサン、1, 3, 5-トリベンジルー1,3,5ートリアザシクロヘキサン、 1. 3. 5-トリフェニルー1, 3, 5-トリアザシク ロヘキサン、2, 4, 6ートリメチルー1, 3, 5ート リアザシクロヘキサン、1,4,7-トリアザシクロノ ナン、1, 4, 7ートリメチルー1, 4, 7ートリアザ シクロノナン、1, 4, 7ートリエチルー1, 4, 7ー トリアザシクロノナン、1,4,7ートリーiープロピ ルー1, 4, 7ートリアザシクロノナン、1, 4, 7-トリー t ーブチルー1, 4, 7 ートリアザシクロノナ ン、1, 4, 7ートリシクロヘキシルー1, 4, 7ート リアザシクロノナン、1,4,7-トリフェニルー1, 4, 7-トリアザシクロノナン等の含窒素多座配位子 類、1,3,5-トリチアシクロヘキサン、1,4,7 - トリチアシクロノナン、1, 4, 7, 10-テトラチ 30 アシクロドデカン、1,5,9,13-テトラチアヘキ サデカン等の含イオウ多座配位子類、1,3,5ートリ オキサシクロヘキサン、1,4,7-トリオキサシクロ ノナン、12-クラウン-4、15-クラウン-5、1 8-クラウン-6等の含酸素多座配位子類が挙げられ

【0080】ブリッジ型構造を有する多座配位子としては、特に限定されるものではないが、例えば、ビス(ジメチルホスフィノエチル)メチルホスフィン等の含 40 リン多座配位子類、ジエチレントリアミン、ビス(ジメチルアミノエチル)メチルアミン、ビス(ジエチルアミノエチル)エチルアミン、ビス(フェニルアミノエチル)アミン、α,α',α"ートリピリジン、2,6ービス(2ーフェニルー2ーアザエテニル)ピリジン、ビス [3ー(2ーピリジルエチルイミノ)ー2ーブタノンオキシム]等の含窒素多座配位子類、ジエチレングリコールメチルエーテル、ビス(メトキシエチル)エーテル、ビス(エトキシエチル)エーテル、ビス(ブトキシエチル)エーテル、ビス(エトキシエチル)(メトキシエチル)エーテル、

エチル) エーテル等の含酸素多座配位子類が挙げられる

【0081】また、上記一般式(1)のBにおいて、炭 素数1~10の炭化水素基としては、特に限定されるも のではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基又はフェ ニル基等が挙げられる。炭素数1~10のカルボキシレ ート基としては、特に限定されるものではないが、例え ば、アセテート基、ナフテネート基又は2-エチルヘキ サノエート基等が挙げられる。炭素数1~10のジケト ナート基としては、特に限定されるものではないが、例 えば、アセチルアセトナート基等が挙げられる。ハロゲ ン原子としては、特に限定されるものではないが、例え ば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子等 が挙げられる。アミド基としては、特に限定されるもの ではないが、例えば、ジメチルアミド基、ジエチルアミ ド基、ジイソプロピルアミド基、ジオクチルアミド基、 ジデシルアミド基、ジドデシルアミド基、ビス(トリメ チルシリル) アミド基、ジフェニルアミド基、N-メチ ルアニリド又はアニリド基等が挙げられる。イミド基と しては、特に限定されるものではないが、例えば、ベン ゾフェノンイミド等が挙げられる。アルコキシド基とし ては、特に限定されるものではないが、例えば、メトキ シド基、エトキシド基、プロポキシド基、ブトキシド基 又はフェノキシド基等が挙げられる。チオアルコキシド 基としては、特に限定されるものではないが、例えば、 チオメトキシド基、チオエトキシド基、チオプロポキシ ド基、チオブトキシド基又はチオフェノキシド基等が挙 げられる。アレーンとしては、特に限定されるものでは ないが、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリ メチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼン又はナフタレン 等が挙げられる。アルケンとしては、特に限定されるも のではないが、例えば、エチレン、プロピレン、ブテ ン、ヘキセン又はデセン等が挙げられる。アルキンとし ては、特に限定されるものではないが、例えば、アセチ レン、フェニルアセチレン又はジフェニルアセチレン等 が挙げられる。アミンとしては、特に限定されるもので はないが、例えば、トリエチルアミン又はトリブチルア ミン等が挙げられる。イミンとしては、特に限定される ものではないが、例えば、ベンゾフェノンイミン又はメ チルエチルケトンイミン等が挙げられる。ニトリルとし ては、特に限定されるものではないが、例えば、アセト ニトリル又はベンゾニトリル等が挙げられる。イソニト リルとしては、特に限定されるものではないが、例え ば、t-ブチルイソニトリル又はフェニルイソニトリル 等が挙げられる。ホスフィンとしては、特に限定される ものではないが、例えば、トリフェニルホスフィン、ト リトリルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン又 はトリブチルホスフィン等が挙げられる。ホスフィンオ キシドとしては、特に限定されるものではないが、例え

ば、トリブチルホスフィンオキシド又はトリフェニルホスフィンオキシド等が挙げられる。ホスファイトとしては、特に限定されるものではないが、例えば、トリフェニルホスファイト、トリトリルホスファイト等が挙げられる。エーテルとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ジエチルエーテル又はテトラヒドロフラン等が挙げられる。スルホンとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ジメチルスルホン又はジブチルスルホン等が挙げられる。スルホキシドとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ジメチルスルホキシド又はジブチルスルホキシド等が挙げられる。スルフィドとしては、特に限定されるものではないが、例えば、エチルスルフィド又はブチルスルフィド等が挙げられる。

【0082】上記一般式(1)で示される中性の多座配 位子が配位したクロム錯体の具体的な例としては、特に 限定されるものではないが、例えば、トリス(メトキシ メチル) メタンクロムトリクロライド(III)、1, 1, 1ートリス (メトキシメチル) エタンクロムトリカ 20 ルボニル(0)、1,1,1-トリス(メトキシメチ ル) エタンクロムトリクロライド(III)、1,1, 1ートリス (メトキシメチル) エタンートリス (ジイソ プロピルアミド)クロム(III)、1,1,1ートリ ス (メトキシメチル) エタンートリス (ジメチルアミ ド) クロム (I I I)、1, 1, 1-トリス (メトキシ メチル) エタンートリス [ビス (トリメチルシリル) ア ミド] クロム (I I I)、1, 1, 1-トリス (メトキ シメチル) エタンクロムトリエトキシド(III)、 1, 1, 1-トリス (メトキシメチル) エタンクロムト リチオブトキシド (III)、1,1,1ートリス (エ トキシメチル) エタンクロムトリクロライド(II I)、1,1,1-トリス(ブトキシメチル)エタンク ロムトリクロライド (III)、1,1,1ートリス (フェノキシメチル) エタンクロムトリクロライド(I II)、トリフリルメタンクロムトリカルボニル (0) 、トリス (5-メチル-2-フリル) メタンクロ ムトリカルボニル (0)、トリス (5-ブチルー2-フ リル) メタンクロムトリカルボニル(0)、トリフリル アミンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフ ィンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフィ ンオキシドクロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス (メチルチオメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(チエニル)メタンクロムトリカルボ ニル (0) 、1, 1, 1-トリス (ジメチルアミノメチ ル) エタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(ピラ ゾリル) メタンクロムトリカルボニル(0)、トリス (3. 5ージメチルー1ーピラゾリル) メタンクロムト リカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド (III) 、

トリス (3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンー トリス (ジエチルアミド) クロム (III) 、トリス (3、5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンートリス (ジイソプロピルアミド) クロム (III) 、トリス (3. 5ージメチルー1ーピラゾリル) メタンートリス [ビス (トリメチルシリル) アミド] クロム (II I)、トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メ タンートリス (ベンゾフェノンイミド) クロム (II I)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メ タンクロムトリエトキシド (III)、トリス (3, 5 ージメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリチオブ トキシド(III)、トリス(3,5ージメチルー1ー ピラゾリル) メタンートルエンクロム(0)、トリス (3. 5-ジメチルー1-ピラゾリル) メタンクロム (エチレン) ジカルボニル (0) 、トリス (3, 5ージ メチルー1ーピラゾリル) メタンクロム (フェニルアセ チレン) ジカルボニル (0) 、トリス (3, 5 - ジメチ ルー1ーピラゾリル) メタンクロム (ジメチルアニリ ン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (ベンゾフェノンイミ ン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム(アセトニトリル)ジカ ルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラ ゾリル) メタンクロム (tーブチルイソニトリル) ジカ ルボニル(0)、トリス(3,5ージメチルー1ーピラ ゾリル) メタンクロム (トリブチルホスフィン) ジカル ボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾ リル) メタンクロム (トリブチルホスフィンオキシド) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1-ピラゾリル) メタンクロム (トリフェニルホスファイ ト) ジカルボニル (0)、トリス (3, 5ージメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (テトラヒドロフラン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンクロム (ジメチルスルホン) ジカル ボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾ リル) メタンクロム (ジメチルスルホキシド) ジカルボ ニル (0) 、トリス (3, 5ージメチルー1ーピラゾリ ル) メタンクロム (ジブチルスルフィド) ジカルボニル (0) 、トリス (3, 5ージイソプロピルー1ーピラゾ リル) メタンクロムトリカルボニル(0)、1,1,1 ートリス (3, 5-ジメチルー1ーピラゾリル) エタン クロムトリカルボニル(0)、1,1,1ートリス (3, 5-ジメチル-1-ピラゾリル) プロパンクロム トリカルボニル(0)、1,1,1-トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)ブタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(2-ピリジル)メタンクロムトリカ ルボニル (0)、トリス (6-メチルー2-ピリジル) メタンクロムトリカルボニル (0)、トリス (2ーピリ ジル) アミンクロムトリカルボニル(0)、トリス(2 50 -ピリジル) ホスフィンクロムトリカルボニル (0)、

トリス (2-ピリジル) ホスフィンオキシドクロムトリ カルボニル (0)、トリス (1ーイミダゾリル) メタン クロムトリカルボニル (0)、1,1,1ートリス (ジ フェニルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、1,1,1ートリス(ジフェニルホスフィノ メチル) エタンクロムトリクロライド (III) 、1, 1, 1ートリス (ジメチルホスフィノメチル) エタンク ロムトリカルボニル (0)、1,1,1ートリス(ジエ チルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニル (0)、1,1,1-トリス(ジエチルホスフィノメチ 10 ル) エタンクロムトリクロライド (III)、1,1, 1-トリス (ジエチルホスフィノメチル) エタンートリ ス (ジイソプロピルアミド) クロム (III) 等の三脚 型構造を有する多座配位子が配位したクロム錯体が挙げ

21

られる。 [0083] $\pm c$, 1, 3, 5-5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1,3,5-トリーiープロピルー1,3,5 ートリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル ートリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(II I)、1,3,5-トリーi-プロピルー1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロムジクロライド(II)、 ジクロロフェニルクロム-1,3,5-トリメチルー 1, 3, 5-トリアザシクロヘキサンクロム (II I) 、ジクロロフェニルクロム-1, 3, 5-トリーi -プロピル-1, 3, 5-トリアザシクロヘキサンクロ ム (I I I)、1,3,5-トリーtーブチルー1, 3, 5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0) $\sqrt{1}$, 3, 5- $\sqrt{1}$ - $\sqrt{1}$ トリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(II I)、1,3,5-トリーtーブチルー1,3,5-ト リアザシクロヘキサンートリス(ジイソプロピルアミ ド) クロム (I I I) 、1, 3, 5-トリシクロヘキシ ルー1, 3, 5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカ ルボニル (0)、2,4,6-トリメチル-1,3,5 - トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1,4,7-トリメチル-1,4,7-トリア ザシクロノナンクロムトリクロライド(III)、1, 4, 7-トリー t ーブチルー 1, 4, 7 ートリアザシク ロノナンクロムトリカルボニル(0)、1,3,5-ト リチアシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、 1, 4, 7-トリチアシクロノナンクロムトリカルボニ ル(0)、1,3,5-トリオキサシクロヘキサンクロ ムトリカルボニル (0)、1,4,7-トリオキサシク ロノナンクロムトリカルボニル (0) 等の環状型構造を 有する多座配位子が配位したクロム錯体が挙げられる。 【0084】さらに、ビス(ジメチルホスフィノエチ

ル) メチルホスフィンクロムトリクロライド(II

I)、ビス(ジフェニルホスフィノエチル)フェニルホ 50

スフィンクロムトリカルボニル(0)、ビス(ジフェニ ルホスフィノエチル) フェニルホスフィンクロムトリク ロライド(III)、ジエチレントリアミンクロムトリ カルボニル (0)、ビス (ジメチルアミノエチル) メチ ルアミンクロムトリクロライド (ΙΙΙ) 、 α, α', α"ートリピリジンクロムトリクロライド(III)、 2, 6-ビス(2-フェニル-2-アザエテニル)ピリ ジンクロムトリクロライド(III)、ビス[3-(2 - ピリジルエチルイミノ) - 2 - ブタノンオキシム〕ク ロムトリクロライド (III)、ビス (メトキシエチ ル) エーテルクロムトリクロライド(III)、ビス (エトキシエチル) エーテルクロムトリクロライド (I II) 等のブリッジ型構造を有する多座配位子が配位し たクロム錯体が挙げられる。

【0085】これらのうち、1-ヘキセン選択性や触媒 活性の面から、一般式(1)の中性の多座配位子として は三脚型構造を有する多座配位子が好ましく用いられ る。また、Bとしてはカルボニル、炭素数1~10の炭 化水素基、ハロゲン原子、アミド及びチオアルコキシド が好ましく用いられる。より好ましくは三脚型構造を有 する多座配位子が配位したクロムのカルボニル錯体、ハ ロゲン錯体及びアミド錯体が用いられる。さらに好まし くは、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メ タンクロムトリカルボニル(0)、トリス(3,5ージ メチル-1-ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド (ІІІ)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリ ル) メタンクロムトリス (ジイソプロピル) アミド (I II)、1,1,1-トリス(メトキシメチル)エタン クロムトリカルボニル (0) 等が用いられる。

【0086】本発明において、上記の中性の多座配位子 が配位したクロム錯体の合成法は、特に限定されるもの ではないが、例えば、中性の多座配位子とクロム化合物 とから公知の錯体形成法 [例えば、J. Amer. Ch em. Soc., 92, 5118 (1970) 及びAn gew. Chem. Int. Ed. Engl., 33, 1877 (1994) 等] により容易に合成することが できる。この場合、使用できるクロム化合物としては、 特に限定されるものではないが、例えば、クロムヘキサ カルボニル(0)、ペンタカルボニル(トリフェニルホ スフィン)クロム(0)、テトラカルボニルビス(エチ レン) クロム(0)、トリカルボニル(ベンゼン)クロ ム(0)、トリカルボニル(トルエン)クロム(0)、 トリカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、 トリカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、トリカルボニル(ナフタレン)クロム(0)、 トリカルボニル (シクロヘプタトリエン) クロム (0)、トリカルボニルトリス(アセトニトリル)クロ ム (0)、トリカルボニルトリス(トリフェニルホスフ ァイト) クロム(0)、(エチレン)ジカルボニル(ト リメチルベンゼン)クロム(0)、シクロヘキシルイソ

ニトリルジカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (O)、トリブチルホスフィンジカルボニル(トリメチ ルベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(シクロペ ンタジエニル) クロム (I) ダイマー、ヒドリドトリカ ルボニル (シクロペンタジエニル) クロム (II) 等の クロムカルボニル化合物類、塩化クロム(III)、塩 化クロム(II)、臭化クロム(III)、臭化クロム (II)、ヨウ化クロム(III)、ヨウ化クロム(I I)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(I I)、トリス (テトラヒドロフラン) クロムクロライド 10 (III)、トリス(1,4-ジオキサン)クロムクロ ライド(III)、トリス(ジエチルエーテル)クロム クロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムクロ ライド(III)、トリス(アセトニトリル)クロムク ロライド(III)等のクロムハロゲン化物類、トリス ・(テトラヒドロフラン) クロムトリス(ジイソプロピル アミド) (III) 、トリス (テトラヒドロフラン) ク ロムトリス (ジエチルアミド) (III) 等のクロムア ミド類、クロム (IV) t-ブトキシド等のクロムアル コキシド類、クロム(III)アセチルアセトナート等 のクロムジケトナート類、クロム(III) 2-エチル ヘキサノエート、クロム (III) アセテート、クロム (III) ナフテネート等のクロムカルボン酸塩類が挙 げられる。

【0087】中性の多座配位子とクロム化合物を反応さ せ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の濃度は特 に制限されない。また、ここで用いられる溶媒として は、特に限定されるものではないが、有機溶媒が好まし く用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタ ン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカ リン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシ レン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素 類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテ ル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハ ロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒は、 それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合 して用いることも可能である。

【0088】また、錯体形成反応は、0℃から使用する 反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは 20~200℃である。反応時間は特に制限されず、通 40 常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。 なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行 なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥 しておくことが好ましい。

【0089】中性の多座配位子が配位したクロム錯体 は、通常固体として沈殿するので、ろ過により反応溶媒 から分離できる。さらに必要に応じて、上記溶媒を用い て洗浄を行い、次いで乾燥して、エチレンの三量化触媒 の構成成分の一つであるクロム錯体が合成される。尚、 沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷 50 ミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリーnーヘ

却処理等により沈殿させることができる。

【0090】本発明においては、中性の多座配位子が配 位したクロム錯体のうち、その多座配位子がfacia 1に配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座 配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いるこ とにより、ポリエチレンの副生が抑えられる等の効果が 認められる。ここで、多座配位子がfacialに配位 した錯体は、配位子が3つ配位した6配位八面体型錯体 の異性体の一つである[化学選書 有機金属化学-基礎 と応用-、143頁(裳華房])。即ち、配位子が3つ 配位した6配位八面体型錯体において、3つの配位子は すべてシス位になるような配置で配位していることを意 味する。

【0091】本発明において使用されるアルキル金属化 合物は、特に限定されるものではないが、例えば、下記 一般式(2)

 $R_{P}MX_{q}$ (2)

(式中、pは0<p≦3であり、qは0≦q<3であっ て、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグ ネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは 炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1 種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール 基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を 表す)で示される化合物が好適なものとして挙げられ

【0092】上記一般式(2)において、炭素数1~1 0のアルキル基としては、特に限定されるものではない が、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、シクロヘキシル基又はオクチル基等が挙げられる。 アルコキシ基としては、特に限定されるものではない が、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基又は フェノキシ基等が挙げられる。アリール基としては、特 に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が 挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定されるも のではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素 が挙げられる。

【0093】なお、上記一般式(2)において、MがA 1で、pとqがそれぞれ1.5のとき、A1R15 X15 となる。このような化合物は、理論的には存在しない が、通常、慣用的にAl2R3X3のセスキ体として表現 されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0094】上記一般式(2)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロピルリチウム、nーブチルリチウム、sーブ チルリチウム、t-ブチルリチウム、ジエチルマグネシ ウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネ シウム、エチルブロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジ エチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエ チルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル

キシルアルミニウム、トリー n ーオクチルアルミニウム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムとドリド、ジイソブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシクロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウムエトキシクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド等が挙げられる。

【0095】これらのうち入手の容易さ及び活性の面から、アルキルアルミニウム化合物が好ましく用いられ、さらに好ましくはトリエチルアルミニウム又はトリイソブチルアルミニウムが用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0096】アルキル金属化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0.1~10000当量であり、好ましくは3~3000当量、より好ましくは5~2000当量である。

【0097】本発明の中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物からなるエチレンの三量化触媒は、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物を原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されない。

【0098】この触媒を調製する際のクロム錯体の濃度 は特に制限されないが、通常、溶媒11あたり0.00 1マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01 マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。これ より小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆にこ れより大きい触媒濃度では、触媒活性が増加せず経済的 でない。また、ここで用いられる溶媒としては、例え ば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタ ン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、 シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタ ン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベ ンゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族 炭化水素類及び塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭 素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられ る。また、反応生成物、即ち、1-ヘキセンを溶媒とし て用いることもできる。これらの溶媒は、それぞれ単独 で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いるこ とも可能である。ここで、エチレンの三量化反応時のク ロム錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて 50

濃縮や希釈しても差し支えない。

【0099】また、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物を接触させる際の温度は-100~250℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、1分~24時間、好ましくは2分~12時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0100】本発明のエチレンの三量化反応は、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物からなる触媒とエチレンを接触させることにより行うことができる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応原料であるエチレンの存在下に、クロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物を接触させて、接触と同時に三量化反応を開始する方法、又はクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物を前もって接触させた後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。

【0101】具体的には、前者の場合は、(1)クロム 錯体、アルキル金属化合物、電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応生成物及びエチレンをそれぞれ同時に 独立に反応系に導入する、(2)アルキル金属化合物を 含む溶液にクロム錯体、電子移動を伴うトポタクティッ クな還元反応生成物及びエチレンを導入する、 (3) ク ロム錯体、電子移動を伴うトポタクティックな還元反応 生成物を含む懸濁液にアルキル金属化合物及びエチレン を導入する、(4)アルキル金属化合物及び電子移動を 伴うトポタクティックな還元反応生成物を含む懸濁液に クロム錯体及びエチレンを導入する、(5)クロム錯体 を含む溶液にアルキル金属化合物、電子移動を伴うトポ タクティックな還元反応生成物及びエチレンを導入す る、という方法により三量化反応を行うことができる。 また、後者の場合は、(1)クロム錯体及び電子移動を 伴うトポタクティックな還元反応生成物を含む懸濁液に アルキル金属化合物を導入する、(2)アルキル金属化 合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生 成物を含む懸濁液にクロム錯体を導入する、 (3) アル キル金属化合物を含む溶液にクロム錯体及び電子移動を 伴うトポタクティックな還元反応生成物を導入する、

(4) クロム錯体を含む溶液に電子移動を伴うトポタク ティックな還元反応生成物とアルキル金属化合物を導入 する、という方法により触媒を調製し、エチレンと接触 させて三量化反応を行うことができる。なお、これらの 原料の混合順序は特に制限されない。

【0102】本発明においては、必要に応じて、中性の 多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物 及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物

27 からなる触媒に光を照射し、エチレンの三量化反応を行

ってもよい。光の照射により触媒活性が大幅に向上する

等の効果が認められる。

【0103】本発明において使用される光は、特に限定 されるものではないが、例えば、紫外光、可視光、赤外 光が挙げられ、発光波長としては、0.2~2000n mの光が好ましく、より好ましくは200~700nm の光が用いられる。また、光の照度は特に制限されな

【0104】光の光源としては太陽光又は人工光源のい ずれを用いてもよいが、太陽光は照度が小さく、天候に 影響され、夜間の使用ができないことから、人工光源が 望ましい。人工光源としては、特に限定されるものでは ないが、例えば、重水素ランプ、キセノンランプ、タン グステンランプ、白熱電球、ハロゲンランプ、低圧水銀 ランプ、ホローカソードランプ、金属蒸気放電管、メタ ルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、タリウムラ ンプ、水銀-タリウムランプ、水銀-鉛ランプ、H型放 電管、キセノン-水銀ランプ、高圧水銀ランプ、超高圧 水銀ランプ、フラッシュランプ等が挙げられる。

【0105】光の照射時期は、特に制限されるものでは ないが、前記のクロム錯体、アルキル金属化合物及び電 子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物からな る触媒に照射してもよいし、またエチレンの三量化反応 系に直接照射してもよい。なお、光の照射時間は特に制 限されない。

【0106】本発明におけるエチレンの三量化反応の温 度は、−100~250℃であるが、好ましくは0~2 00℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気で あれば特に制限されないが、通常、絶対圧で0.01~30 $3000 \text{kg}/\text{cm}^2$ であり、好ましくは0. $1\sim30$ Okg/cm^{*}である。また、反応時間は温度や圧力に 左右され、一概に決めることはできないが、通常、5秒 ~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つ ように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧 力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレ ンには、反応に不活性なガス、例えば、窒素、アルゴ ン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。な お、エチレンの三量化反応のすべての操作は、空気と水 分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分 に乾燥しておくことが好ましい。

【0107】本反応は、回分式、半回分式、連続式のい ずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反 応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水 溶液等の重合失活剤を添加して反応を停止させる。失活 した廃クロム触媒は、公知の脱灰処理方法、例えば、水 又はアルカリ水溶液による抽出等で除去した後、生成し た1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液 より分離される。また、副生するポリエチレンは、反応 液出口で公知の遠心分離法や1-ヘキセンの蒸留分離の 50

際の残渣として分離除去される。

[0108]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いてさらに詳細 に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すも ので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな

【0109】参考例1

シュレンク管で、J. Amer. Chem. Soc., 92,5118 (1970) に記載の方法で合成した三 脚型構造を有するトリス(3,5-ジメチル-1-ピラ ゾリル) メタン 238mg、クロムヘキサカルボニル 176mg、メシチレン40m1及びトルエン10ml を混合し、窒素雰囲気下で1時間攪拌しながら加熱還流 した。析出した結晶をろ過し、トリス(3,5-ジメチ ルー1-ピラゾリル) メタンクロムトリカルボニル

(0) (以下、錯体Aと称する)を得た。この錯体Aの IR分析を行った結果、CO吸収に基づく2本のピーク が1896cm ¯¹ と1759cm ¯¹ に認められ、トリス (3. 5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンがクロム にfacialで配位していることを示した。

【0110】参考例2

二硫化モリブデン7.0g(44mmol)にn-ヘキ サン100mlを添加した後、n-ブチルリチウムのn -ヘキサン溶液 (1. 54M) 57ml (88mmo 1)を滴下した。この懸濁液を室温で3日間撹拌し、上 済液を除去した後、n-ヘキサンで洗浄した。その後、 室温、10⁻³ Torrで乾燥し、次いで75~85℃、 10 Torrで乾燥して黒色固体を得た。得られた生 成物を元素分析した結果、組成は(Li^{*})1.20 [Mo S_2] .20- $var{b}$

【0111】上記還元反応生成物7.0gに25%アン モニア水130mlを添加した。この懸濁液を−30℃ で30分間攪拌し、上澄液を除去した後、水で洗浄し た。

【0112】ジメチルアニリン塩酸塩7.1g(45m mol)を500mlの水に溶解し、この水溶液に上記 ルイス塩基処理生成物 7.0gを添加した。この懸濁液 を室温で24時間撹拌し、上済液を除去した後、水及び エタノールで洗浄した。その後、室温、10°Torr で24時間乾燥し、黒色固体(以下、化合物-1と称す る)を得た。得られた化合物-1を元素分析した結果、 組成は [Ph (Me) 2NH] 0.12 [MoS2] 0.12 で あった。

【0113】実施例1

シュレンク管に、化合物-1を0.20g、0.154 mol/lのトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキ サン溶液2. 1ml及び乾燥したトルエン40mlを入 れ、混合攪拌し、懸濁液を得た(以下、懸濁液Cと称す

【0114】温度計及び攪拌装置を備えた内容積150

mlのガラス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを6.9mg、0.154mol/lのトリイソブチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液2.1mlと乾燥したトルエン40mlを入れ、混合撹拌した。ウシオ電気製超高圧水銀ランプ(500W)を用い、外部から光を30分間照射した後、上記懸濁液Cを混合した。

29

【0115】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を1400rpmに調整後、反応容器にエチレンを導入して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の絶対圧力を5kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0116】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1Torr、100℃)して、その重量を*

* 測定した。さらに、この乾燥固体を電気炉で700℃で 焼成して、その強熱残分を測定し、乾燥固体から強熱残 分を減じた重量をポリマー重量とした。結果を表1に示 す。

【0117】 実施例2

化合物-1を0.40g用いたこと以外、実施例1と同様にして反応を行なった。結果を表1に示す。

【0118】比較例1

化合物-1を用いなかったこと以外、実施例1と同様に 10 して反応を行なった。結果を表1に示す。

【0119】比較例2

錯体Aの代わりに(1、3、5-トリメチルベンゼン) クロムトリカルボニル(0)(以下、錯体Bと称する) を4.1mg用いたこと以外、実施例1と同様にして反 応を行なった。結果を表1に示す。触媒活性は低く、ま たポリエチレンの副生が増加した。

[0120]

【表1】

| | | 実施例1 | 実施例 2 | 比較例1 | 比較例 2 | |
|---|---------------|--------------|-----------|------------|------------|--|
| 触媒 | - | | | | | |
| Cr錯体 | | 錯体A | 錯体A | 錯体A | 錯体 B | |
| | μmol | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| アルキル金属化 | と合物 | i – Bu » A l | i – BusAl | i – Bu A l | i – Bu, Al | |
| | μmo l | 640 | 640 | 240 | 640 | |
| 電子移動を伴う | うトポタクティ | 化合物 - 1 | 化合物-1 | - | 化合物ーし | |
| ックな還元反射 | 5生成物 mg | 200 | 400 | _ | 200 | |
| 遊媒 | | トルエン | トルエン | トルエン | トルエン | |
| 反応条件 | | | | | | |
| 反応温度 | \mathcal{C} | 80 | 80 | 80 | 8.0 | |
| 反応圧力 | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 反応時間 | 分 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 3.0 | |
| 結果 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | | | T '. | | | |
| 触媒活性 g-1-4+t>/g-Cr-瞬 | | 2960 | 3450 | 445 | 467 | |
| 液体 | wt% | 93.8 | 92.5 | 99.0 | 47.6 | |
| ** ** * | wt% | 6. 2 | 7.5 | 1.0 | 52.4 | |
| 液体中の | wt% | | | | | |
| 生成物分布 | C 4 | 2. 2 | 1.6 | 4.4 | 7.3 | |
| | C 6 | 94.7 | 95.7 | 77.9 | 69.9 | |
| | C 8 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 6.2 | |
| | C 1 0 | 1.6 | 1.3 | 5.6 | 6.0 | |
| | C 1 2 + | 1. 1 | 1.0 | 9.8 | 10.6 | |
| C 6 純度 | wt% | 98.2 | 98.2 | 96.2 | 99.0 | |

(注) C4;7'テン、C8;ヘキセン、C8;オクテン、C10; デセン、C12+; ドデセンル上の表現オレフィン、 PE: ポリエチレン、C6版度=(1-ヘキセン/全ヘキセン)×100

[0121]

【発明の効果】本発明によれば、中性の多座配位子が配り、エチレンから効率よく、位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を40ンを製造することができる。 伴うトポタクティックな還元反応生成物の少なくとも3※

※成分からなるエチレンの三量化触媒を用いることにより、エチレンから効率よく、かつ高選択的に1ーヘキセンを製造することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl.

識別記号 300 FI C07B 61/00 テーマコード(参考)

300

// C 0 7 B 61/00

F ターム(参考) 4G069 AA06 BA21A BA21B BA27A BA27B BC04A BC10A BC16A BC16B BC58A BC58B BD03A CB47

> 4H006 AA02 AC21 BA02 BA05 BA09 BA14 BA31 BA32 BA36 BA47 BA81 BA85 BA95

4H039 CA19 CF10

4J028 AA01A AA02A AB00A AB01A AC01A AC22A AC32A AC42A AC44A AC45A BA00A BA01B BB00A BB00B BB01B BC01B BC06B BC09B BC18B CA07A . CA11A CA24A CA47A CA51A CA58A